## 強誘電体薄膜:SBT/Pt/-/SiのXAFS 解析

(株)松下テクノリサーチ 尾崎 伸司

## <u>ozaki@mtr.mei.co.jp</u>

強誘電体を利用する不揮発性メモリ(FeRAM)の本格的応用が非接触型 IC カートから始まろうとしている。応用への最大の問題は DRAM に比較し高集積化が桁違いに難しい事である。原因はシリ コンプロセスで多用される還元作用を伴う処理である。還元作用のダメージにより、キャバシタのリーク電流 が増加し、ひどい場合には膜剥がれが起きることが知られている。

SBT:SrBi<sub>2</sub>Ta<sub>2</sub>O<sub>9</sub> は書き換えによる強誘電性劣化が少なく、低電圧動作特性が優れるという特徴から近年注目を集めている。SBT 膜の還元に着目した解析を行う場合、最も有効な分析手法の一つがXAFSである。XAFS により、他の分析手法では捉えることが難しい、還元によるアモルファス成分の挙動や Bi のサイト選択性(ペロブスカイト層 / Bi 酸化層サンドイッチ構造)等を調べることができる。

SBT/Pt/-/Si に代表される強誘電体デルイスの XAFS 分析では、下部電極の特性への影響が顕 著で、強誘電体膜厚が数 100nm 以下と薄いため、下部電極の存在が無視出来ない。SBT/Pt系 の場合、BiとPtのL吸収端、蛍光X線L線が近接し通常の蛍光 XAFS では分析が困難である。

アンジュレータの特徴である BM の 2 桁~3 桁アップの高輝度で大強度なビームを生かし、大強度ビーム フラックスにより可能となった高分解能な波長分散蛍光 X 線分光と高輝度 X 線の賜物である斜入射 測定に有利な測定系を組み合わせた、新規な XAFS 測定法を試みたので報告する。

## <u>強誘電体薄膜:SBT/Pt/-/Si</u> の XAFS 解析

(株)松下テクノリサーチ 尾崎 伸司 ozaki@mtr.mei.co.jp

## 実験の動向:産業専用 BL(1999 年-2000 年)

- 1.半導体
- ・ キャパシタ、 ゲート 2 0 % SBT : SrBi<sub>2</sub>Ta<sub>2</sub>O<sub>9</sub>、 PZT : Pb(ZrTi)O<sub>3</sub> BST : (BaSr)TiO<sub>3</sub>、 Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>、 SiO<sub>2</sub>/Si
- 2. 電池
- ・Li イオン 2 次電池 1 5 % LiCoO<sub>2</sub>、LiNiO<sub>2</sub>、Li(CoNi)O<sub>2</sub>、LiMn<sub>2</sub>O<sub>4</sub>
- ・燃料電池 14%

LaMnO<sub>3</sub>、 YSZ:  $(Y_2O_3)_x(ZrO_2)_{1-x}$ 



(a) ペロブスカイト構造
SrTiO<sub>3</sub>, PbTiO<sub>3</sub>, Pb (Zr, Ti) O<sub>3</sub>, (Pb, La) (Zr, Ti) O<sub>3</sub>.



図5 強誘電体の二つの結晶構造



Fig. BiLIII XAFS spectrum of SBT/Pt/-/S



Fig. The incident angle ( ) dependence of BiLIII XAFS spectrum for SBT/Pt/ - /Si



Fig. Bi LIII XAFS spectrum of SBT/Pt/-/S



Fig. Bi, Pt and TaL spectra of SBT/Pt/-/Si









(blank)